

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 22 年 2 月 25 日 (2010.2.25)

【公表番号】特表 2009-523325 (P2009-523325A)
 【公表日】平成 21 年 6 月 18 日 (2009.6.18)
 【年通号数】公開・登録公報 2009-024
 【出願番号】特願 2008-550404 (P2008-550404)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/673 (2006.01)

B 6 5 D 85/86 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/68 T

B 6 5 D 85/38 R

【手続補正書】
 【提出日】平成 22 年 1 月 6 日 (2010.1.6)

【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

密閉でき且つ少なくとも 1 つの基板を収容するように適応された包囲体と、
 上記包囲体へ通じていて、基板キャリアが閉じられている間に上記包囲体へのガスの流れを許容するように適応された第 1 のポートと、
を備え、

上記包囲体の内側の圧力が上記包囲体の外側の圧力より高い、基板キャリア。

【請求項 2】

上記第 1 のポートは、ガス源が上記第 1 のポートに対して密閉されるように適応された第 1 のシールを含む、請求項 1 に記載の基板キャリア。

【請求項 3】

上記第 1 のポートは、第 2 のシールを含む、請求項 2 に記載の基板キャリア。

【請求項 4】

上記第 2 のシールは、上記第 1 のシールを取り囲むように配設される、請求項 6 に記載の基板キャリア。

【請求項 5】

上記第 1 のポートは、上記基板キャリアのドアに配設され、
真空源に対して密閉され且つ上記基板キャリアのドアに真空力を加えられるように適応された第 2 のシールを含む、
 請求項 2 に記載の基板キャリア。

【請求項 6】

上記ドアに加えられる上記真空力は、上記第 1 のポートを通して上記基板キャリア内へガスが流されることにより生成される力に対抗するように適応される、請求項 5 に記載の基板キャリア。

【請求項 7】

第 2 のポートを更に含み、上記第 2 のポートは、ガスを上記基板キャリアから流出できるように適応され、上記第 2 のポートは、排気チャネルを上記第 2 のポートに対して密閉できるように適応された第 1 のシールを含む、請求項 1 に記載の基板キャリア。

【請求項 8】

上記第 2 のポートは、更に、上記第 2 のポートの上記第 1 のシールの周りに配設された第 2 のシールを含み、上記第 2 のシールは、真空源に対して密閉され、且つ上記基板キャリアの上記第 2 のポートの上記第 1 のシールの周りの領域へ真空力を加えられるようにして、上記第 1 のポートを通して上記基板キャリア内へガスを流すことにより生成される力に対抗するように適応される、請求項 7 に記載の基板キャリア。

【請求項 9】

ロードポートにおいて、

基板キャリアを開放するため上記基板キャリアのドアに結合するように適応されたプレートを用意、

上記プレートは、上記プレートの第 1 の側部において上記基板キャリアのドアにおける第 1 のポートに結合し且つ上記プレートの第 2 の側部においてガス源に結合するように適応された第 1 の開口を含み、

上記ロードポートは、上記プレートにおける上記第 1 の開口を通して上記基板キャリアへのガスの流れを許容するように適応される、

ロードポート。

【請求項 10】

上記プレートは、更に、第 2 の開口を含み、

上記第 2 の開口は、上記プレートの上記第 2 の側部において真空源に結合するように適応され、上記第 2 の開口は、上記第 1 の開口の周りに配設された空間が上記プレートの上記第 1 の側部において排気されるように配設され、上記空間は、上記第 1 の開口を上記第 1 のポートに対して密閉する第 1 のシール及び上記第 1 のシールの周りに配設され上記第 2 の開口を上記第 1 のポートに対して密閉する第 2 のシールによって画成される、請求項 9 に記載のロードポート。

【請求項 11】

排気チャネルを更に含み、

上記プレートは、更に、上記プレートの上記第 2 の側部において上記排気チャネルに結合され且つ上記プレートの上記第 1 の側部において上記基板キャリアにおける第 2 のポートに結合される第 3 の開口を含む、

請求項 10 に記載のロードポート。

【請求項 12】

基板キャリアの外側の圧力よりも高い圧力を上記基板キャリアの内側に生成するように上記基板キャリアへガスを流すステップと、

ドア開口を通して上記基板キャリアからガスを流出させるため上記基板キャリアのドアを開放するステップと、
を備えた方法。

【請求項 13】

上記ガスを流すステップは、密閉された基板キャリアへ上記ガスを流す段階を含む、請求項 12 に記載の方法。

【請求項 14】

上記ガスを流すステップは、

上記ガスを上記基板キャリアの上記ドアに配設された第 1 のポートを通して上記基板キャリアへ流す段階と、

上記ガスが上記基板キャリアへ流れることによって生成される力に対抗するように上記ドアに真空力を加える段階と、

を含む、請求項 12 に記載の方法。

【請求項 15】

上記基板キャリアの上記ドアに配設された第 2 のポートを通して上記基板キャリアから空気を排出することを更に含む、請求項 14 に記載の方法。